

XPS 樣品檢測資訊

<p>[注意事項]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 樣品特性務必誠實申報，若申報不實造成儀器損壞或污染，由所屬單位或指導教授負責賠償並停止儀器使用權。 • 粉末只收 (1)滴在矽晶片上、(2)壓錠、(3)壓印在銅箔上樣品，請自行製備並充分烘乾。 • 真空抽30分鐘無法到達high vacuum($<10^{-3}$ torr)、或3小時後無法到達工作壓力($<10^{-5}$ torr)，會退件並收取真空時數費。 						
<p>[樣品載檯限制]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 偵測大小：diameter 6 mm • 載台大小：(L) 60 mm x (W) 10 mm x (H) 2 mm • 一個載台最多放10件樣品。 			<p>[蝕刻]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 蝕刻速率：SiO₂ 600 V 60 sec ~40 nm • 縱深分析有自動蝕刻功能，一次只能放3個10 mm x 10 mm樣品。 			
X光靶材		<input type="checkbox"/> Al (0~1300 eV) <input type="checkbox"/> Mg (0~1200 eV)				
觀察部位		<input type="checkbox"/> 表面分析 (請填寫測試項目1~3) <input type="checkbox"/> 縱深分析 (請填寫測試項目1~4) <input type="checkbox"/> Angle resolved (請填寫測試項目1,2,3,5)				
樣品次序		Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5
1	名稱或代號					
2	導電性 (若導電性差peak shift會較多)	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
3	化學組成					
4	具放射性	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
5	具磁性	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
6	具毒性	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
7	具揮發性	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
8	樣品型態	<input type="checkbox"/> Thin film <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Bulk	<input type="checkbox"/> Thin film <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Bulk	<input type="checkbox"/> Thin film <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Bulk	<input type="checkbox"/> Thin film <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Bulk	<input type="checkbox"/> Thin film <input type="checkbox"/> Powder <input type="checkbox"/> Bulk
測試項目						
1	全能譜掃描範圍 Survey range (eV)					
2	單元素軌域與範圍					
3	表面清潔	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4	成份縱深分析 (膜層結構、各層深度、蝕刻終點等)					
5	Angle resolved analysis (角度範圍-30deg~+40deg)					
Note						